

消費税法改定に伴う利用料金改定のお知らせ

令和元年10月1日付で消費税法が改定されることに伴い、下表に示しましたように利用料金を改定させていただきます。

	現行	改正後
装置利用料金	消費税8%に対応した料金	消費税10%に対応した料金 詳細：別表（装置利用料金表）参照
消耗品費	消費税8%に対応した料金	消費税10%に対応した料金
装置利用料金の上限額	アカデミック 上記以外 324万円 1,404万円	330万円 1,430万円
基本料金		据え置き
事前講習・技術代行等における技術料		据え置き
サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金 サテライトラボ（専有部分） セミナー室	1日当たり 165円 1時間当たり 21円	1日当たり 168円 1時間当たり 21円

表 1-1. 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

装置群	No.	装置等 機器名	利用料金(一時間当り)						設置場所
			タイプA		タイプB		タイプC		
			改定前	改定後	改定前	改定後	改定前	改定後	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	26,430円	26,620円	42,290円	42,590円	52,870円	53,240円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	10,570円	10,650円	16,920円	17,040円	21,150円	21,300円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	7,170円	7,230円	11,480円	11,560円	14,350円	14,450円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	4,080円	4,110円	6,530円	6,570円	8,160円	8,210円	イロールーム
	A5	両面マスクアライナー	2,850円	2,870円	4,560円	4,590円	5,700円	5,740円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	440円	450円	710円	710円	880円	890円	イロールーム
	A7	厚膜フォトリソ用スピニング装置	1,560円	1,570円	2,490円	2,500円	3,110円	3,130円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	790円	800円	1,270円	1,280円	1,590円	1,600円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	1,010円	1,020円	1,610円	1,620円	2,010円	2,030円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	790円	800円	1,270円	1,280円	1,590円	1,600円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	1,470円	1,490円	2,360円	2,380円	2,950円	2,970円	イロールーム
	A12	ICP質量分析装置	2,450円	2,470円	3,930円	3,950円	4,910円	4,940円	イロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	1,080円	1,090円	1,720円	1,740円	2,150円	2,170円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	1,060円	1,070円	1,690円	1,700円	2,110円	2,130円	イロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	34,890円	35,140円	55,830円	56,220円	69,780円	70,280円	加工・評価室 1
A16	近接効果補正システム	-	930円	-	1,480円	-	1,850円	-	
A53	移動マスク紫外線露光装置	4,320円	4,350円	6,910円	6,950円	8,630円	8,690円	桂クリーンルーム	
A54	両面マスクアライナー露光装置	680円	680円	1,080円	1,090円	1,350円	1,360円	桂クリーンルーム	
B ナノ材料加工・創製装置	B1	多元スパッタ装置 (仕様A)	4,040円	4,070円	6,470円	6,510円	8,080円	8,140円	加工・評価室 1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様B)	3,850円	3,880円	6,160円	6,200円	7,700円	7,750円	加工・評価室 1
	B3	電子線蒸着装置	3,170円	3,200円	5,080円	5,110円	6,340円	6,390円	クリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	620円	630円	1,000円	1,010円	1,250円	1,260円	加工・評価室 1
	B5	プラズマCVD装置	6,420円	6,470円	10,270円	10,340円	12,840円	12,930円	クリーンルーム 1
	B6	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	12,950円	13,040円	20,710円	20,860円	25,890円	26,080円	加工・評価室 1
	B7	熱酸化炉	940円	950円	1,500円	1,510円	1,870円	1,890円	クリーンルーム 2
	B8	深堀ドライエッチング装置	5,270円	5,310円	8,430円	8,500円	10,540円	10,620円	クリーンルーム 1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	5,290円	5,330円	8,460円	8,520円	10,570円	10,650円	クリーンルーム 1
	B10	ドライエッチング装置	910円	920円	1,450円	1,460円	1,810円	1,830円	クリーンルーム 2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	3,630円	3,650円	5,800円	5,840円	7,250円	7,300円	クリーンルーム 2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	4,230円	4,270円	6,770円	6,820円	8,470円	8,530円	クリーンルーム 1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	2,130円	2,150円	3,410円	3,440円	4,270円	4,300円	クリーンルーム 2
	B14	赤外フェムト秒レーザ加工装置	3,550円	3,580円	5,680円	5,720円	7,100円	7,150円	加工・評価室 2
	B15	レーザーアノール装置	3,370円	3,390円	5,390円	5,420円	6,730円	6,780円	加工・評価室 2
	B16	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	4,520円	4,560円	7,240円	7,290円	9,050円	9,110円	イロールーム
	B17	基板接合装置	4,110円	4,140円	6,580円	6,620円	8,220円	8,280円	イロールーム
	B18	レーザダイシング装置	6,780円	6,830円	10,850円	10,930円	13,560円	13,660円	加工・評価室 1
	B19	ダイシングソー	610円	620円	980円	990円	1,230円	1,240円	加工・評価室 1
	B20	真空マウンター	530円	530円	850円	850円	1,060円	1,060円	加工・評価室 1
	B21	紫外線照射装置	230円	240円	370円	380円	470円	470円	加工・評価室 1
	B22	エキスパンド装置	120円	130円	200円	200円	250円	250円	加工・評価室 1
	B23	ウェッジワイヤボンダ	260円	270円	420円	420円	530円	530円	加工・評価室 2
	B24	ボールワイヤボンダ	270円	280円	430円	440円	540円	550円	加工・評価室 2
	B25	ダイボンダ	240円	250円	390円	390円	490円	490円	加工・評価室 2
	B26	ナノインプリントシステム	1,080円	1,090円	1,720円	1,740円	2,150円	2,170円	イロールーム
	B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	1,020円	1,030円	1,630円	1,640円	2,030円	2,050円	イロールーム
	B28	電子線蒸着装置 (2)	410円	410円	650円	660円	820円	820円	加工・評価室 2
	B29	高性能マッフル炉	50円	50円	70円	70円	90円	90円	加工・評価室 2
	B30	UVオゾンクリーナー・キュア装置	-	570円	-	900円	-	1,130円	クリーンルーム 2
B51	バリウム成膜装置	360円	360円	570円	580円	720円	720円	桂クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	500円	510円	810円	810円	1,010円	1,010円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	330円	330円	520円	520円	650円	650円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	4,560円	4,600円	7,300円	7,350円	9,120円	9,190円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	180円	180円	280円	290円	350円	360円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	570円	580円	920円	930円	1,150円	1,160円	桂クリーンルーム	

表 1-2. 装置等の利用負担金表

令和元年10月1日 改定

装置等		利用料金(一時間当り)						設置場所	
装置群	No.	機器名	タイプA		タイプB		タイプC		
			改定前	改定後	改定前	改定後	改定前		改定後
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	4,830円	4,860円	7,720円	7,780円	9,650円	9,720円	加工・評価室 1
	C2	分析走査電子顕微鏡	6,720円	6,770円	10,760円	10,830円	13,440円	13,540円	加工・評価室 1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	2,570円	2,590円	4,110円	4,140円	5,140円	5,170円	加工・評価室 2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	2,340円	2,350円	3,740円	3,760円	4,670円	4,700円	加工・評価室 2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	2,500円	2,520円	4,000円	4,030円	5,000円	5,040円	加工・評価室 2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	1,000円	1,010円	1,610円	1,620円	2,010円	2,020円	加工・評価室 1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	2,040円	2,060円	3,270円	3,300円	4,090円	4,120円	加工・評価室 2
	C9	長時間撮写蛍光イメージングシステム	1,550円	1,570円	2,480円	2,500円	3,110円	3,130円	加工・評価室 2
	C10	X線回折装置	2,720円	2,740円	4,350円	4,380円	5,440円	5,480円	加工・評価室 1
	C11	分光エリプソメーター	1,660円	1,670円	2,650円	2,670円	3,310円	3,340円	クリーンルーム 2
	C12	光ピンセットシステム	1,960円	1,980円	3,140円	3,160円	3,920円	3,950円	加工・評価室 2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	1,070円	1,080円	1,720円	1,730円	2,150円	2,160円	加工・評価室 2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	1,430円	1,440円	2,290円	2,300円	2,860円	2,880円	加工・評価室 2
	C15	触針式段差計 1	460円	470円	740円	740円	920円	930円	クリーンルーム 2
	C15	触針式段差計 2	460円	470円	740円	740円	920円	930円	加工・評価室 1
	C16	マイクロシステムアナライザ	2,830円	2,850円	4,530円	4,560円	5,660円	5,700円	加工・評価室 1
	C17	(プローバ)	630円	640円	1,010円	1,020円	1,260円	1,270円	加工・評価室 1
	C18	(真空プローバ)	2,470円	2,490円	3,950円	3,980円	4,940円	4,970円	加工・評価室 1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	800円	810円	1,280円	1,290円	1,600円	1,610円	加工・評価室 1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	330円	340円	530円	540円	660円	670円	加工・評価室 1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	1,060円	1,070円	1,690円	1,700円	2,110円	2,130円	加工・評価室 2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	1,060円	1,070円	1,690円	1,700円	2,110円	2,130円	加工・評価室 2
	C24	セルテストシステム	1,050円	1,060円	1,680円	1,690円	2,100円	2,110円	加工・評価室 2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	390円	400円	620円	630円	780円	790円	クリーンルーム 1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	350円	360円	560円	570円	700円	710円	加工・評価室 1
	C27	(RFプローブキット)	140円	150円	230円	230円	290円	290円	加工・評価室 1
	C28	(ネットワークアナライザ)	360円	360円	570円	580円	710円	720円	加工・評価室 1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	350円	360円	560円	570円	700円	710円	加工・評価室 1
	C30	強誘電体特性評価システム	720円	730円	1,150円	1,160円	1,440円	1,450円	加工・評価室 1
	C31	接触式シート抵抗測定器	-	310円	-	500円	-	620円	加工・評価室 1

- 備考
- 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された 1 時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
 - ・タイプ A：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用（標準利用負担金（タイプ C）の額の 5 0%を 1 0 円単位で四捨五入した額とする）
 - ・タイプ B：中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用 及び ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用（標準利用負担金（タイプ C）の額の 8 0%を 1 0 円単位で四捨五入した額とする）
 - ・タイプ C：ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用
 - 1 時間未満の機器利用及び 1 時間を超える機器利用に係る 1 時間未満の端数については、それぞれ 1 時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
 - 複数の機器を利用する場合には、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
 - 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表 4 の基本料金を負担いただきます。
 - 中小企業とは中小企業基本法第 2 条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人